

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

<p>In re application of: Tetsuya ODA et al. Serial No.: Currently unknown Filing Date: Concurrently herewith For: METHOD OF FORMING THICK-FILM WIRING AND METHOD OF PRODUCING LAMINATED ELECTRONIC COMPONENT</p>	
--	--

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS

Mail Stop PATENT APPLICATION
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450
Alexandria, VA 22313-1450

Dear Sir:

Enclosed herewith is a certified copy of each of Japanese Patent Application Nos. **2002-353772** filed **December 5, 2002** and **2003-353100** filed **October 14, 2003**, from which priority is claimed under 35 U.S.C. 119 and Rule 55b. Acknowledgement of the priority document is respectfully requested to ensure that the subject information appears on the printed patent.

Respectfully submitted,

Date: December 1, 2003



Attorneys for Applicant(s)
Joseph R. Keating
Registration No. 37,368

Christopher A. Bennett
Registration No. 46,710

KEATING & BENNETT LLP
10400 Eaton Place, Suite 312
Fairfax, VA 22030
Telephone: (703) 385-5200

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2002年12月 5日

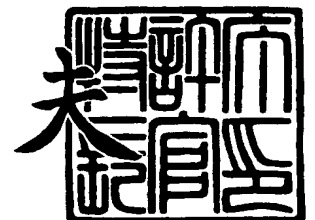
出願番号
Application Number: 特願2002-353772
[ST. 10/C]: [JP2002-353772]

出願人
Applicant(s): 株式会社村田製作所

2003年10月27日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今井 康夫



出証番号 出証特2003-3088563

【書類名】 特許願

【整理番号】 10575

【提出日】 平成14年12月 5日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H05K 3/20

【発明者】

 【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田
 製作所内

 【氏名】 小田 哲也

【発明者】

 【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田
 製作所内

 【氏名】 藤居 長一朗

【発明者】

 【住所又は居所】 京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号 株式会社村田
 製作所内

 【氏名】 西川 悦生

【特許出願人】

 【識別番号】 000006231

 【氏名又は名称】 株式会社村田製作所

 【代表者】 村田 泰隆

【代理人】

 【識別番号】 100085497

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 筒井 秀隆

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 036618

 【納付金額】 21,000円



【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9004890

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 厚膜配線の形成方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 基体上に厚膜配線を形成する方法であって、
所望の厚膜配線パターンに対応するパターン溝が表面に形成された光透過性を有する凹版のパターン溝に、感光性導電性ペーストを埋め込む第 1 の工程と、
上記パターン溝に埋め込まれた感光性導電性ペーストに対し凹版の表裏両側から紫外線または可視光線を照射し、硬化反応を生じさせて導電性ペーストの全周を所定の硬度まで硬化させる第 2 の工程と、
上記凹版内で硬化した導電性ペーストを基体に直接または中間体を介して間接的に転写する第 3 の工程と、
上記導電性ペーストを焼成することによって、厚膜配線を基体上に形成する第 4 の工程と、を有する厚膜配線の形成方法。

【請求項 2】 上記凹版は透明な P E T フィルムよりなることを特徴とする請求項 1 に記載の厚膜配線の形成方法。

【請求項 3】 上記凹版は透明な P E T フィルムよりなり、
上記第 2 の工程は、凹版の表裏両側から 350 nm より波長の長い紫外線のみを照射することを特徴とする請求項 1 に記載の厚膜配線の形成方法。

【請求項 4】 上記凹版は透明な P E T フィルムよりなり、
上記凹版のパターン溝は、上記紫外線より短い波長を持つレーザー光によって加工され、
上記 P E T フィルムは、上記レーザー光の透過性が低く、上記紫外線の透過性が高い波長吸収スペクトルを有することを特徴とする請求項 1 または 3 に記載の厚膜配線の形成方法。

【請求項 5】 上記中間体は光透過性を有する材料よりなり、
上記第 2 の工程は、導電性ペーストが充填または塗布された凹版に対して中間体を重ね合わせた状態で、凹版の裏側および中間体の裏側の両方から紫外線または可視光線を照射するものであり、
上記第 3 の工程は、凹版内で硬化した導電性ペーストを中間体に転写した後、中

間体上の導電性ペーストを基体に再転写するものであることを特徴とする請求項 1 ないし 4 のいずれかに記載の厚膜配線の形成方法。

【請求項 6】 上記第 2 の工程における凹版の表側から照射される紫外線または可視光線の照射量を、裏側から照射される紫外線または可視光線の照射量より多くしたことを特徴とする請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の厚膜配線の形成方法。

【請求項 7】 上記凹版は可撓性を有する樹脂製凹版であり、この樹脂製凹版は光透過性を有する非可撓性の支持体上に貼り合わされていることを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の厚膜配線の形成方法。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

本発明は、厚膜配線の形成方法であって、特に線幅が微細で、かつ膜厚の比較的大きな（ $10\mu\text{m}$ 以上）配線を基体上に形成するのに適した方法に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

【特許文献 1】 特許第 3 0 3 9 2 8 5 号公報

【特許文献 2】 特開平 1 1 - 1 5 4 7 8 2 号公報

近年、電子機器の小型化に伴って、機器内で使用される電子部品の小型化も進んでいる。このような状況下、電子部品のパターンにおいても、パターンを構成する配線の微細化、ライン抵抗の低減化を目的とした厚膜配線が要求されている。このような目的を達成するため、特許文献 1 では、可撓性樹脂凹版に導電性ペーストを充填し、ペーストを乾燥した後、乾燥による体積吸収分を補うため、追加の導電性ペーストを再充填し、再充填後の導電ペーストを再乾燥する工程を複数回繰り返す、基板上に接着層を形成し、凹版を基板に貼り合わせ、導電性ペーストを基板に転写した後、焼成して厚膜配線を得るものが提案されている。

しかし、この方法では、導電性ペーストの充填と乾燥を複数回繰り返さなければならないので、作業工数が多く、作業時間が長いという問題がある。

【0 0 0 3】

一方、金属粉末を含む光硬化型の導電性ペーストを透明な凹版の溝内に埋め込み、溝内の導電性ペーストに基板を接触させた状態で凹版側から紫外線を照射し、光硬化反応を生じさせて導電性ペーストを硬化させると共に基板に接着させ、その後、凹版を基板から分離して硬化した導電性ペーストを基板側に転写し、次いで導電性ペーストを焼成することによって厚膜配線を基板上に形成する方法も提案されている（特許文献 2 参照）。

この方法では、上記のような導電性ペーストの充填・乾燥を繰り返す必要がないので、作業工数を削減できる利点がある。

【0 0 0 4】**【発明が解決しようとする課題】**

しかしながら、導電性ペーストの厚みが例えば $20\ \mu\text{m}$ 以上の厚膜になると、図 10 の（a）に示されるように、導電性ペースト P の中に含まれる金属粉末のために紫外線 UV が奥まで届かず、透明な凹版 4 1 の溝 4 2 に接する部分では硬化部 P 1 となるが、基板 4 0 に接する部分に未硬化部 P 2 が発生する。そのため、基板 4 0 を凹版 4 1 から分離したとき、導電性ペースト P の一部が凹版 4 1 の溝 4 2 に残り、図 10 の（b）のように転写不良が発生する可能性があった。

したがって、従来方法では所定以上の厚みの厚膜配線を形成することが困難であった。

【0 0 0 5】

そこで、本発明の目的は、導電性ペーストの厚みが所定以上になっても、凹版から基体へ導電性ペーストを確実に転写することが可能な厚膜配線の形成方法を提供することにある。

【0 0 0 6】**【課題を解決するための手段】**

上記目的を達成するため、請求項 1 に係る発明は、基体上に厚膜配線を形成する方法であって、所望の厚膜配線パターンに対応するパターン溝が表面に形成された光透過性を有する凹版のパターン溝に、感光性導電性ペーストを埋め込む第 1 の工程と、上記パターン溝に埋め込まれた感光性導電性ペーストに対し凹版の表

裏両側から紫外線または可視光線を照射し、硬化反応を生じさせて導電性ペーストの全周を所定の硬度まで硬化させる第2の工程と、上記凹版内で硬化した導電性ペーストを基体に直接または中間体を介して間接的に転写する第3の工程と、上記導電性ペーストを焼成することによって、厚膜配線を基体上に形成する第4の工程と、を有する厚膜配線の形成方法を提供する。

【0007】

凹版から基体へ導電性ペーストを直接転写する方法を例にして説明すると、まず表面にパターン溝が形成された光透過性を有する凹版のパターン溝に、感光性導電性ペーストを埋め込む。この埋込工程は、例えば導電性ペーストを凹版の表面に供給し、スキージなどで余分の導電性ペーストを掻き取ることにより、簡単に実施できる。

次に、パターン溝に埋め込まれた感光性導電性ペーストに対し凹版の表裏両側から紫外線または可視光線を照射し、硬化反応を生じさせて導電性ペーストの全面を所定の硬度まで硬化させる。例えば、導電性ペーストが紫外線硬化型の場合、紫外線を凹版の表裏両側から照射することで、凹版の表面に露出している導電性ペーストの露出部には直接紫外線が照射され、凹版の溝と接している導電性ペーストの部分には凹版を通して紫外線が照射される。導電性ペーストの中には、金属粉末、有機バインダ、光重合開始剤、光硬化性モノマーなどが含まれるが、凹版の表裏両側から紫外線が照射されるので、導電性ペーストの全周（全面）が所定硬度まで硬化され、導電性ペーストの凝集力が高くなる。したがって、従来のように導電性ペーストが溝内に残るといった転写不良が発生しない。

次に、凹版内で硬化した導電性ペーストを基体に転写する。すなわち、凹版の表面に基体を押し付けることで、導電性ペーストと基体間に発生する粘着力によって基体の表面に乗り移る。このとき、導電性ペーストと基体との粘着力または接着力を、導電性ペーストと凹版との粘着力または接着力より大きくしておくことで、凹版の溝に導電性ペーストの一部が残留せず、転写不良を防止できる。

導電性ペーストを基体に転写した後、導電性ペーストを焼成することによって、厚膜配線を基体上に形成する。例えば、基体を焼成炉に投入し、一体に焼成することで、厚膜配線を形成できる。

上記のように凹版の表裏両側から紫外線または可視光線を照射するので、凹版に埋め込まれた導電性ペーストの全周（全面）を所定硬度まで硬化させることができ、転写性が向上する。そのため、 $20\mu\text{m}$ 以上の厚みを持つ導電性ペーストであっても、転写不良を解消できる。

【0008】

請求項2のように、凹版を透明なPETフィルムで構成するのがよい。

光透過性の凹版としてガラスが考えられるが、凹版からの剥離時に凹版を曲げることができず、剥離性がよくない。また、ガラスの場合、溝加工はエッチング加工になるが、約 $2\mu\text{m}$ 程度と深く掘れない。

そこで、凹版を透明なPETフィルムで構成することで、剥離時に凹版を曲げることができ、しかも溝の加工性もよく、安価に構成できる。

樹脂材料としてはポリイミドが考えられるが、ポリイミドは紫外線透過率が約60%程度と低い。これに対し、PETフィルムは紫外線透過率が約90%以上と高いので、導電性ペーストの硬化反応を効果的に生じさせることができる。

【0009】

請求項3のように、凹版は透明なPETフィルムよりなり、第2の工程は、凹版の表裏両側から 350nm より波長の長い紫外線のみを照射するのがよい。

凹版に樹脂フィルムを用いる場合、凹版の紫外線による劣化が懸念される。PETフィルムには、図7に示すように光の波長吸収スペクトルがあり、紫外線領域では比較的波長の短い 300nm 以下の波長を吸収しやすい。第2の工程で連続的に紫外線を照射すると、凹版は光を吸収し、劣化が進む。そこで、紫外線照射時には波長カットフィルタ（例えばガラス板に波長カット材料をコーティングしたもの）を間に入れ、 350nm 以下の波長の紫外線をカットすることで、凹版の耐久性を上げることができる。

図8はPETフィルムへの紫外線の積算光量とPETフィルムの引張強度との関係を示したものであり、フィルタを用いない場合には $5000\text{J}/\text{cm}^2$ 以下でPETフィルムの引張強度がほぼ零まで低下していたのに対し、フィルタを用いた場合には $85000\text{J}/\text{cm}^2$ 付近まで引張強度を維持することができた。

【0010】

請求項4のように、凹版は透明なPETフィルムよりなり、凹版のパターン溝は、上記紫外線より短い波長を持つレーザー光によって加工され、上記PETフィルムは、上記レーザー光の透過性が低く、上記紫外線の透過性が高い波長吸収スペクトルを有するものがよい。

PETフィルムに溝加工を行なう場合、レーザー光を用いると、深い溝を容易に加工できるので望ましい。しかし、PETフィルムには上記のように光の波長吸収スペクトルがあるので、ペーストが硬化反応を起こす波長（紫外線）での光透過性がよく、かつレーザー光による加工性に優れているものがよい。

PETフィルムの場合、図7に示すように320nm付近で光透過率が急激に変化する。そこで、加工波長が190～250nmのエキシマレーザーを用いれば、レーザー光をほぼ100%吸収するので、加工性が優れ、短時間で所望の深さ（20μm以上）の溝を加工できる。

また、上述のようにPETフィルムが紫外線による光透過性に優れているので、凹版の耐久性が向上する。

【0011】

凹版から基体へ導電性ペーストを直接転写する方法に代えて、凹版から中間体、中間体から基体へと2段階の転写を行ってもよい。すなわち、請求項5のように中間体を光透過性を有する材料で形成し、第2の工程を、導電性ペーストが充填された凹版に対して中間体を重ね合わせた状態で、凹版の裏側および中間体の裏側の両方から紫外線または可視光線を照射するものとし、第3の工程を、凹版内で硬化した導電性ペーストを中間体に転写した後、中間体上の導電性ペーストを基体に再転写してもよい。

導電性ペーストPを凹版に充填した際、凹版の表面に掻き取り残り（地汚れ）が発生することがある。凹版から基体へ直接転写する方法の場合、地汚れも一緒に転写されてしまう可能性がある。そこで、中間体を介して間接的に基体へ転写する方法を用いれば、地汚れは非常に膜厚が薄いため、中間体へは転写されるが、基体へは転写されない。そのため、基体の表面に地汚れのない綺麗な導体パターンを得ることができる。

【0012】

請求項 6 のように、凹版の表面から照射される紫外線または可視光線の照射量を、裏面から照射される紫外線または可視光線の照射量より多くするのがよい。

凹版から基体への導電性ペーストの転写性を向上させる方法としては、例えば凹版の表面（溝内を含む）に予めフッ素系樹脂などの離型剤をコーティングする方法、基体の表面に予め粘着剤あるいは接着剤を塗布しておく方法、凹版の溝の断面形状をその側面が所定のテーパ角を有する台形状とする方法など種々の方法が考えられるが、これらの方法とは別に、あるいはこれらの方法に加えて、請求項 6 の方法を用いるのがよい。

図 9 に示すように、紫外線の積算光量により導電ペーストと凹版の剥離性が変化する。透明な中間体を重ねてから両面 UV 照射する場合、中間体側からは密着力が大きくなる条件（積算光量または照射量を多くする）で、凹版側からは密着力が小さくなる条件（積算光量または照射量を少なくする）で硬化することで、中間体へ容易に転写可能となる。

なお、中間体を介さず、基体に直接転写する場合も、基体が透明であればこの方法を用いることができる。

この方法は、光源の光の強さまたは照射時間を長くするだけでよいので、上述の他の方法に比べて処理が簡単である。

【 0 0 1 3 】

請求項 7 のように、凹版を可撓性を有する樹脂製凹版とし、この樹脂製凹版を光透過性を有する非可撓性の支持体上に貼り合わせて構成するのがよい。

例えば、凹版をガラスなどの硬質材料で形成した場合、上記のようにパターン溝をイオンエッチングやイオントリミングによって加工する必要上、加工コストが高く、特に深溝を形成するには大きな課題があった。また、比較的安価なウエットエッチングでの加工は、主に金属などの光透過性を有しない材料が対象物であり、等方性エッチングになるため、アスペクト比の大きな溝加工ができない。

一方、PET や PC のような樹脂フィルムにレーザー加工することで凹版とする方法もあるが、この場合には基体への転写時に凹版を変形させながら引き剥がすので、パターン歪みが生じ、精密な導体パターンが得られないだけでなく、凹版へのダメージが大きく、劣化が激しい。

そこで、請求項7では加工の容易な可撓性材料よりなる樹脂製凹版を、ガラスなどの非可撓性（硬質）の支持体上に貼り合わせることで、上記の課題を解決している。すなわち、凹版と支持体とを介して紫外線や可視光線を照射でき、凹版を変形させずに転写できるので、歪みがなく、精密な導体パターンが得られるとともに、凹版の劣化も少ない。

【0014】

【発明の実施の形態】

図1は本発明方法を実施する転写装置の第1実施例を示す。

この転写装置は、円筒ドラム形状の凹版1を備えている。この凹版1は、透明ガラスなどの紫外線透過性を有する材料で形成されており、その外表面に所望の厚膜配線パターンに対応するパターン溝2が形成されている。パターン溝2の深さは20 μ m以上で、アスペクト比（縦／横）は1に近いものがよい。凹版1の直径は ϕ 300～600mmが望ましい。凹版1は矢印方向に一定速度で駆動される。

【0015】

凹版1の外周部には、パターン溝2へ導電性ペーストPを供給するための供給装置3が設けられている。導電性ペーストPは金属粉末などを含み、紫外線を照射することにより硬化反応を起こすものを用いる。導電性ペーストPは乾燥性の高いものであれば溶剤系でもよいが、無溶剤系の方が望ましい。乾燥時に体積減少を防止できるからである。供給装置3は、導電性ペーストPを溜めるペースト受け4と、ペースト受け4のペーストPを凹版1に塗布する塗布ロール5と、溝以外のペーストPを掻き取るためのスキージ6とを備えている。スキージ6は例えばポリアセタールなどの硬質樹脂を用いるのがよい。スキージ6によって、導電性ペーストPはパターン溝2へ完全に充填される。

【0016】

パターン溝2へ充填された導電性ペーストPは、凹版1の回転に伴って第1ロール7の位置まで移動し、ここで供給ロール9から連続的に供給されたキャリアシート8と重ね合わせられる。キャリアシート8は、凹版1から導電性ペーストPを受け取り、基体20へ受け渡すための中間体として働くものであり、例えばP

E T、P C、ポリエステル、ポリスチロール等の紫外線透過性を有するシートが使用される。

【0017】

凹版1とキャリアシート8は重ね合わせられた状態で矢印方向に回転し、露光部10を通過することによって、導電性ペーストPに硬化反応を生じさせ、導電性ペーストPの全面を所定硬度まで硬化させる。露光部10には、凹版1の内側から紫外線を照射する光源11と、キャリアシート8の裏側から紫外線を照射する光源12とが設けられている。なお、13、14は凹版1が吸収する波長をカットするフィルタである。光源11、12には高圧水銀灯やメタルハライドランプなどが用いられ、それぞれの露光量が例えば $0.2 \sim 1.0 \text{ J/cm}^2$ 程度となるよう紫外線を照射する。この時の紫外線強度は $0.1 \sim 0.2 \text{ W/cm}^2$ 、照射時間は1～10秒、凹版1の回転数は約2rpm程度が望ましい。

【0018】

露光部10を通過したキャリアシート8は、第2ロール15によって凹版1から剥離される。導電性ペーストPは凹版1内で硬化反応する際、重ね合わせられたキャリアシート8との間に接着力が発生し、第2ロール15でキャリアシート8へ転写される。第1ロール7から第2ロール15までの領域では、格別な押圧手段は必要とせず、重ね合わせておけば、ペーストPの粘着力のみで転写可能である。

【0019】

表1は、紫外線の露光量と、転写性および導体パターン形状の良否を示したものである。転写性とは、硬化後の導電性ペーストが凹版から基体へ転写された割合をいう。また、導体パターン形状とは、基体へ転写された後の形状のことである。◎は非常に良い、○は良い、×は悪い、－はデータなしを示している。導体パターン形状については、転写後の導体パターンの断面形状がパターン溝2の断面形状に近いものを良い、崩れているものを悪いとした。

【0020】

【表 1】

露光量(j/cm ²)	転写性	導体パターン形状
0.1	×	—
0.4	◎	◎
0.8	◎	◎
1.5	○	○
2.5	×	×

【0021】

表 1 から分かるように、露光量が 0.1 J/cm^2 以下ではキャリアシート 8 への転写に耐えるだけの凝集力が得られず、 2.5 J/cm^2 以上では硬化反応は十分進んでいるが、凹版 1 との接着力が強くなり、良好な剥離性が得られない。したがって、凹版 1 の内側（導電性ペースト P の裏側）からの露光量は $0.2 \sim 1.5 \text{ J/cm}^2$ の範囲が望ましい。

【0022】

この実施例では、凹版 1 からキャリアシート 8 への転写性を高めるため、凹版 1 の内側（導電性ペースト P の裏側）からの紫外線照射量に比べて、キャリアシート 8 の裏側（導電性ペースト P の表側）からの紫外線照射量（露光量）を多くしている。例えば、凹版 1 の内周に配置された光源 11 の照射時間に比べて、キャリアシート 8 の裏側に配置された光源 12 の照射時間を長くしたり、光源 11 の紫外線強度に比べて光源 12 の紫外線強度を高くしている。

こうすることで、導電性ペースト P の溝側の接着力に比べて、導電性ペースト P のキャリアシート 8 側の接着力の方が大きくなり、凹版 1 からキャリアシート 8 への転写性が向上する。

具体的には、凹版 1 の内側（導電性ペースト P の裏側）からの紫外線照射量を $0.2 \sim 1.5 \text{ J/cm}^2$ とし、キャリアシート 8 の裏側（導電性ペースト P の表側）からの紫外線照射量を 1.5 J/cm^2 以上とするのがよい。

【0023】

第 2 ロール 15 を通過した導電性ペースト P 付きのキャリアシート 8 は、再転写部 16 へ送られる。再転写部 16 には一対の転写ロール 17, 18 が配置され、その間で基体 20 とキャリアシート 8 とが圧接され、導電性ペースト P は基体 2

0へ再転写される。ここでは、基体20としてキャリアフィルムによって裏打ちされたセラミックグリーンシートが用いられ、供給ロール19から連続的に供給される。キャリアシート8から基体20への導電性ペーストPの転写性を高めるため、 $200 \sim 500 \text{ kg/cm}^2$ 程度の圧縮荷重を掛けるのがよい。また、転写ロール17、18の内部にヒータ等を設け、例えば $60 \sim 90^\circ\text{C}$ の温度下で転写すれば、基体20内部のバインダ成分が軟化し、転写性が向上する。スキージ6によって導電性ペーストPをパターン溝2へ充填した際、凹版1の表面に掻き取り残り（地汚れ）があった場合でも、キャリアシート8へは転写されるが、基体20へは転写されない。地汚れは非常に膜厚が薄いためである。そのため、基体20の表面には地汚れのない綺麗な導体パターンが得られる。なお、転写ロール17、18に比較的高硬度（例えばJIS-A60以上）のゴム製ロールを用いることで、一層効果的に地汚れのない転写を実現できる。

【0024】

転写後のキャリアシート8は巻取ロール21に回収され、基体20は巻取ロール22に回収される。その後、導電性ペーストPが転写された基体20は、所定枚数積層された後、図示しない焼成炉へ送られ、導電性ペーストPと同時焼成される。ここで、導電性ペーストPは内部に含まれた金属粉末が熔融し、厚膜配線となるとともに、基体20はセラミック基板へと変化する。

【0025】

上記2回の転写の際、位置精度を高めるため、凹版1とキャリアシート8、キャリアシート8と基体20は、例えば導体パターン以外にアライメントマークを設けておき、それを基準にして位置合わせし、転写するのがよい。

【0026】

図2は本発明方法を実施する転写装置の第2実施例を示す。

この実施例では、中間体としてのキャリアシート8を用いずに、凹版1から基体20へ導電性ペーストPを直接転写するものである。なお、第1実施例と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

供給装置3によって凹版1のパターン溝2に充填された導電性ペーストPに対して、凹版1の表裏（内外）両側に配置されたUV用光源11、12から紫外線が

照射される。紫外線UVを凹版1の表裏両側から照射することで、凹版1の表面に露出している導電性ペーストPの露出部には直接紫外線が照射され、凹版1の溝2と接している導電性ペーストPの部分には凹版1を通して紫外線が照射される。その結果、導電性ペーストPの全周が所定硬度まで硬化（乾燥）され、導電性ペーストPの凝集力が高くなる。

【0027】

次に、凹版1内で硬化した導電性ペーストPを基体20に転写する。この場合の基体20も、キャリアフィルムによって裏打ちされたセラミックグリーンシートであり、供給ロール19から連続的に供給される。そして、基体20は転写ロール18によって凹版1に押しつけられ、導電性ペーストPは凹版1から基体20へ転写される。この場合も、導電性ペーストPの転写性を高めるため、 $200 \sim 500 \text{ kg/cm}^2$ 程度の圧縮荷重を掛けたり、転写ロール18の内部にヒータ等を設けてもよい。

【0028】

図3は本発明方法を実施する転写装置の第3実施例を示す。

この実施例では、中間体を用いずに基体20へ直接転写するとともに、基体20として焼成済みセラミック板のような硬質基板を用いたものである。

凹版1の表裏（内外）両側に配置されたUVランプ11、12によって、パターン溝2内で所定硬度まで硬化された導電性ペーストPは、凹版1の下端面に沿って水平移動する基体20へ直接転写される。

この場合も、パターン溝2内の導電性ペーストPの全周が所定硬度まで硬化（乾燥）されているので、導電性ペーストPの凝集力が増し、基体20への転写性が向上する。

【0029】

図4は本発明にかかる厚膜配線の形成装置の第4実施例を示す。

この実施例では、凹版30として平板状の凹版を用いたものである。なお、第1実施例と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

凹版1は透明ガラスなどの硬質平板よりなり、表面にパターン溝2が形成されている。パターン溝2の深さは $20 \mu\text{m}$ 以上で、アスペクト比（縦／横）は1がよ

い。凹版 1 上に導電性ペースト P が供給され、スキージ 6 で余分の導電性ペースト P を掻き取ることで、パターン溝 2 に導電性ペースト P が充填される。

【0030】

導電性ペースト P が充填された凹版 1 は、第 1 ロール 7 の位置で中間体であるキャリアシート 8 と重ね合わせられる。キャリアシート 8 は、第 1 ロール 7、第 2 ロール 15、ガイドロール 32, 33, 34 の間を矢印方向に周回しており、ガイドロール 33 の近傍には、キャリアシート 8 の表面に残った地汚れを除去する清掃手段 35 が設けられている。スキージ 6 によって導電性ペースト P をパターン溝 2 へ充填した際、凹版 1 の表面に掻き取り残り（地汚れ）があった場合、キャリアシート 8 に地汚れが残るが、この地汚れは清掃手段 35 によって除去されるので、キャリアシート 8 を繰り返し使用することができる。

【0031】

凹版 1 とキャリアシート 8 は重ね合わせられた状態で水平方向に移動し、露光部 10 を通過することによって、導電性ペースト P に硬化反応を生じさせ、導電性ペースト P の全面を所定硬度まで硬化させる。露光部 10 には、凹版 1 の下側から紫外線を照射する光源 11、キャリアシート 8 の上側から紫外線を照射する光源 12、フィルタ 13, 14 などが配置されている。

【0032】

露光部 10 を通過した凹版 1 およびキャリアシート 8 は、第 2 ロール 15 によって相互に剥離される。このとき、導電性ペースト P は凹版 1 内で硬化反応する際、重ね合わせられたキャリアシート 8 との間に接着力が発生しているので、キャリアシート 8 へ確実に転写される。この場合も、凹版 1 からキャリアシート 8 への転写性を高めるため、凹版 1 の下側からの紫外線照射量に比べて、キャリアシート 8 の上側からの紫外線照射量（露光量）を多くするのがよい。

【0033】

第 2 ロール 15 は転写ロールを兼ねており、第 2 ロール 15 と対をなす転写ロール 18 との間で基体 20 とキャリアシート 8 とが圧接され、導電性ペースト P は基体 20 へ再転写される。この基体 20 も、キャリアフィルムによって裏打ちされたセラミックグリーンシートである。キャリアシート 8 から基体 20 への導電

性ペースト P の転写性を高めるため、 $200 \sim 500 \text{ kg/cm}^2$ 程度の圧縮荷重を掛けてもよいし、転写ロール 15, 18 の内部にヒータ等を設けてもよい。

【0034】

図 5 は本発明にかかる厚膜配線の形成装置の第 5 実施例を示す。

この実施例では、中間体としてのキャリアシート 8 を用いずに、凹版 1 から基体 20 へ導電性ペースト P を直接転写するものである。なお、第 4 実施例と同一部分には同一符号を付して重複説明を省略する。

供給装置 3 によって凹版 1 のパターン溝 2 に充填された導電性ペースト P に対して、凹版 1 の表裏両側に配置された UV 用光源 11, 12 から紫外線が照射される。紫外線 UV を凹版 1 の表裏両側から照射することで、凹版 1 の表面に露出している導電性ペースト P の露出部には直接紫外線が照射され、凹版 1 の溝 2 と接している導電性ペースト P の部分には凹版 1 を通して紫外線が照射される。その結果、導電性ペースト P の全面が所定硬度まで硬化（乾燥）され、導電性ペースト P の凝集力が高くなる。

この場合も、凹版 1 の裏側（下側）から照射される紫外線に比べて、凹版 1 の表側（上側）から照射される紫外線の照射量（露光量）を多くすることで、パターン溝 2 から露出する導電性ペースト P の粘着性または接着性を高めるとともに、導電性ペースト P の凝集力を高めることができる。

【0035】

導電性ペースト P の硬化が終了した凹版 1 を転写ロール 18 の下方へ通過させ、凹版 1 内で硬化した導電性ペースト P を基体 20 に転写する。この場合の基体 20 も、キャリアフィルムによって裏打ちされたセラミックグリーンシートであり、供給ロール 19 から連続的に供給される。そして、基体 20 は転写ロール 18 によって凹版 1 に押しつけられ、導電性ペースト P は凹版 1 から基体 20 へ転写される。この場合も、導電性ペースト P の転写性を高めるため、 $200 \sim 500 \text{ kg/cm}^2$ 程度の圧縮荷重を掛けたり、転写ロール 18 の内部にヒータ等を設けてもよい。

【0036】

第 1 ～ 第 5 の実施例では、凹版 1 を透明ガラスなどの硬質材料で形成したが、図

6に示すように、PETやPCなどの透明樹脂フィルムの表面にレーザー加工によってパターン溝2を形成した凹版1を用い、この凹版1を透明ガラスなどの硬質材料よりなる透明な支持体40の外表面に貼り合わせてもよい。

図6の(a)はドラム状の凹版1を示し、図6の(b)は平板状の凹版1を示す。

この場合も、凹版1および支持体40が共に紫外線透過性を有するので、支持体40の内側および凹版1の外側から紫外線を照射することで、パターン溝2に充填された導電性ペーストPの全面を硬化させることができる。また、可撓性を有する樹脂フィルムにレーザー加工することで凹版1とするので、加工が容易である。さらに、凹版1が支持体40によって変形が防止されるので、凹版1からキャリアシート8へ導電性ペーストPを転写する時、あるいは凹版1から基体20へ導電性ペーストPを転写する時、凹版1を変形させずに済み、パターン歪みや凹版1の劣化を防止できる利点がある。

【0037】

上記実施例では、導電性ペーストPを紫外線硬化型である例について説明したが、可視光線によって硬化する性質を持つ導電性ペーストであってもよい。

また、凹版1をPETフィルムなどの透明な軟質の樹脂材料のみで形成することも可能である。

上記実施例では、凹版から基体（または中間体）への導電性ペーストの転写性を向上させる方法として、凹版の表面から照射される紫外線または可視光線の照射量を、裏面から照射される紫外線または可視光線の照射量より多くしたが、これとは別にあるいはこれと共に、凹版の表面に予めフッ素系樹脂などの離型剤をコーティングしたり、基体（または中間体）の表面に予め粘着剤あるいは接着剤を塗布しておく方法などを用いてもよい。

【0038】

【発明の効果】

以上の説明で明らかなように、請求項1に係る発明によれば、凹版を用いて厚膜配線を形成する方法において、パターン溝に埋め込まれた感光性導電性ペーストに対し凹版の表裏両側から紫外線または可視光線を照射するので、導電性ペース

トの全面で硬化反応を生じさせることができ、導電性ペーストの全周で凝集力が高くなる。そのため、 $20\mu\text{m}$ 以上の厚みを持つ導電性ペーストであっても、導電性ペーストは残留なく基体の表面に乗り移らせることができ、転写不良を少なくできる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明方法で用いられる転写装置の第 1 実施例の構造図である。

【図 2】

本発明方法で用いられる転写装置の第 2 実施例の構造図である。

【図 3】

本発明方法で用いられる転写装置の第 3 実施例の構造図である。

【図 4】

本発明方法で用いられる転写装置の第 4 実施例の構造図である。

【図 5】

本発明方法で用いられる転写装置の第 5 実施例の構造図である。

【図 6】

凹版の他の例の側面図である。

【図 7】

PET フィルムにおける光の波長吸収スペクトルである。

【図 8】

PET フィルムの紫外線の積算光量と引張り強度との関係を示す図である。

【図 9】

紫外線の積算光量による導電ペーストと凹版との剪断剥離強度を示す図である。

【図 10】

従来における厚膜配線の形成方法の一例の断面図である。

【符号の説明】

P 導電性ペースト

1 凹版

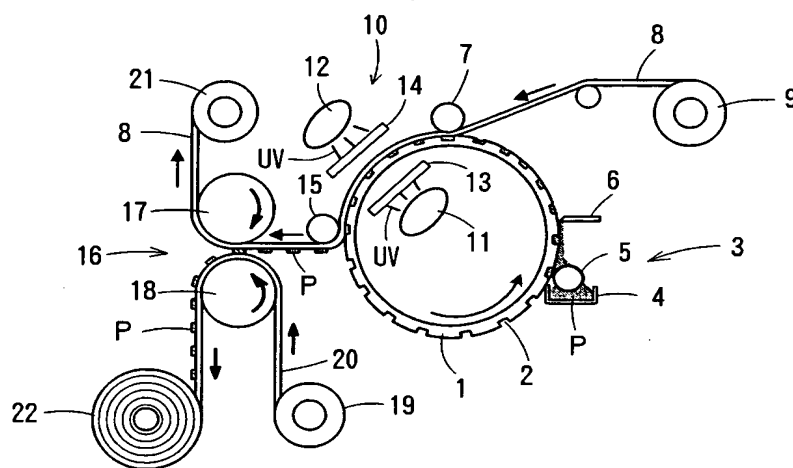
2 パターン溝

- 6 スキージ
- 8 中間体（キャリアシート）
- 1 0 露光部
- 1 1, 1 2 UV光源
- 2 0 基体（セラミックグリーンシート）

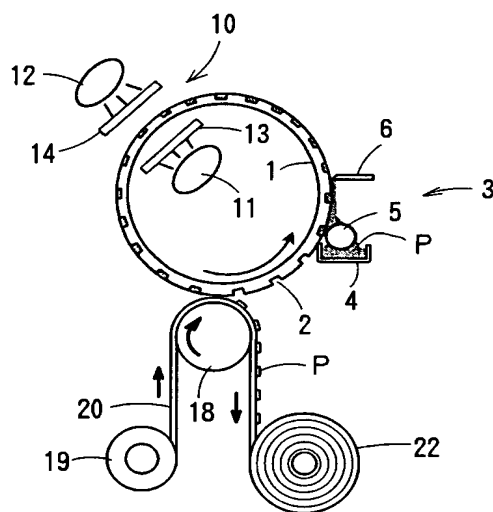
【書類名】

図面

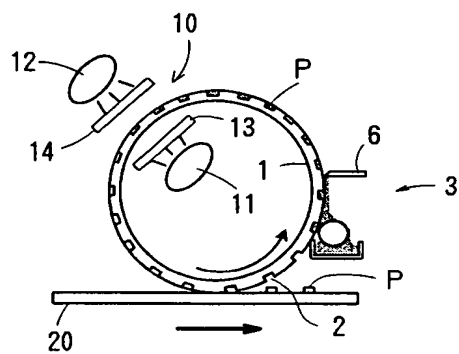
【図 1】



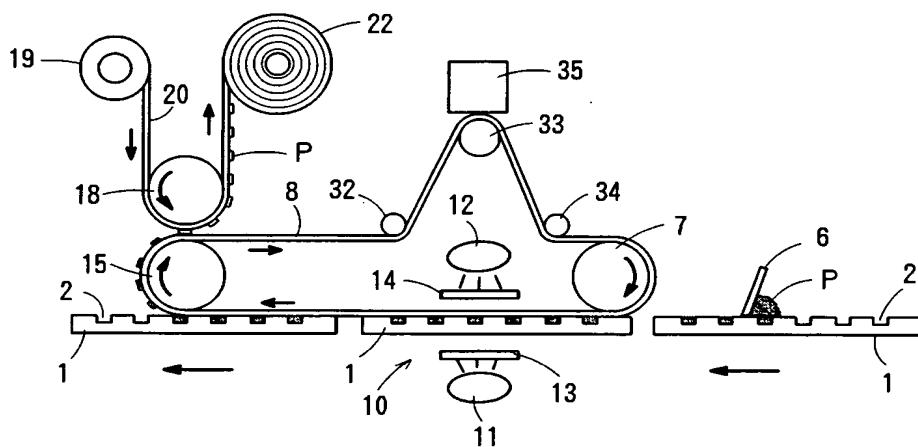
【図 2】



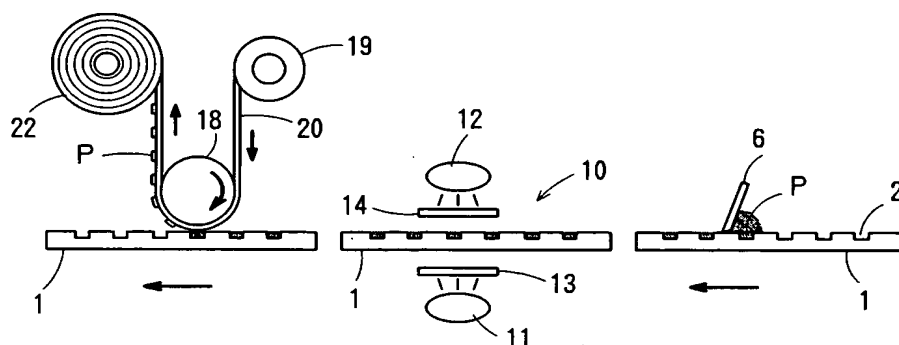
【図 3】



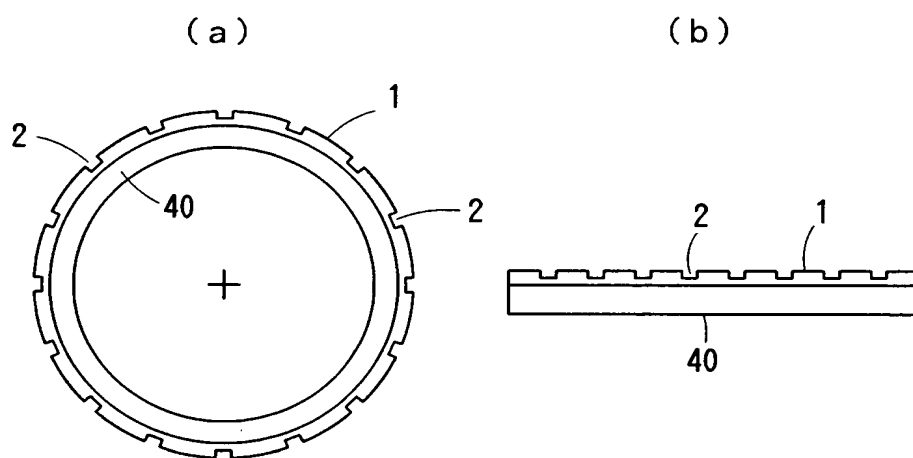
【図 4】



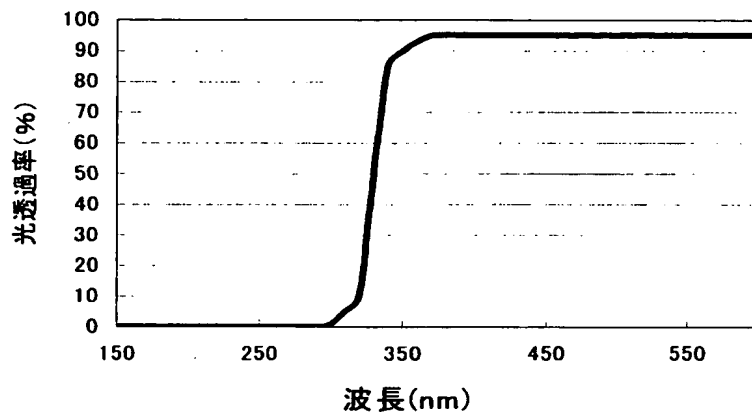
【図 5】



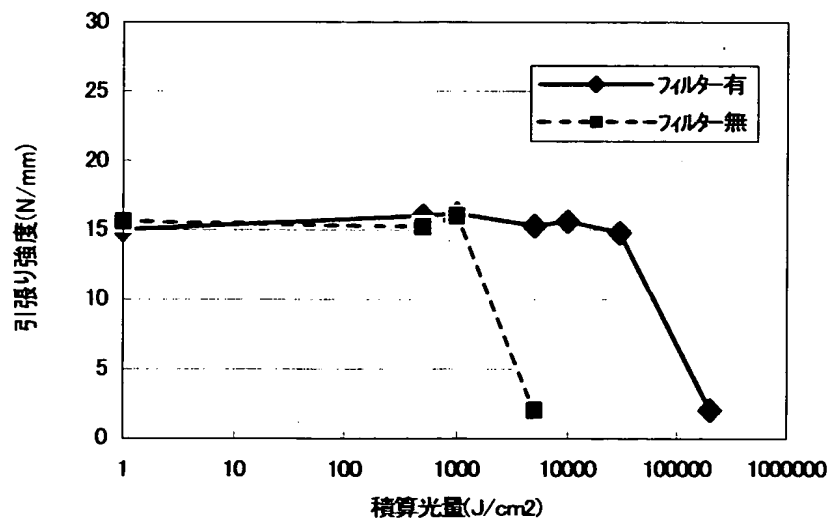
【図 6】



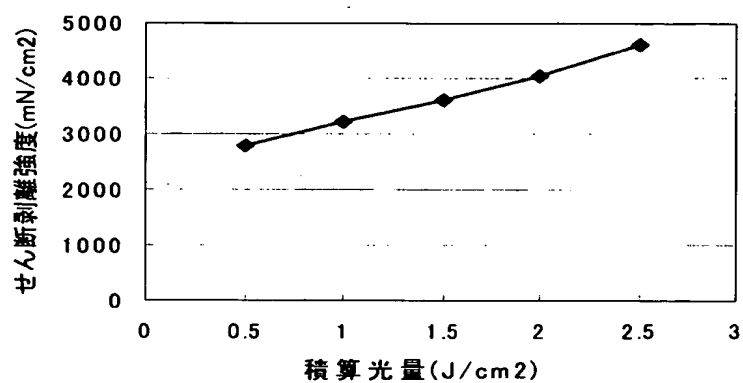
【図 7】



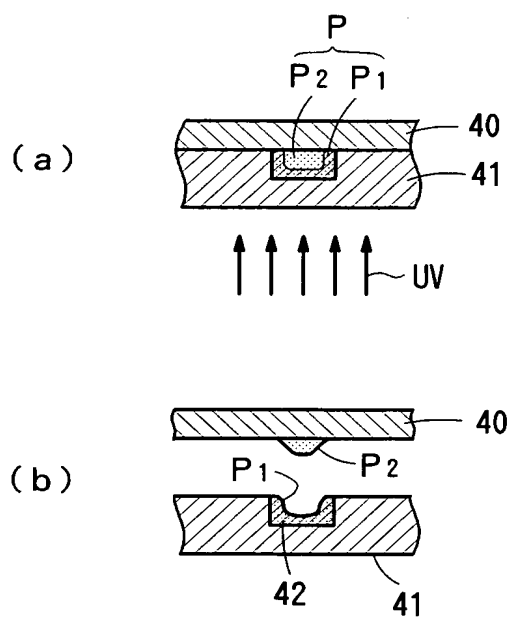
【図 8】



【図 9】



【図 10】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 導電性ペーストの厚みが所定以上になっても、凹版から基体へ導電性ペーストを確実に転写することが可能な厚膜配線の形成方法を提供する。

【解決手段】 所望の厚膜配線パターンに対応するパターン溝 2 が表面に形成された光透過性を有する凹版 1 のパターン溝に感光性導電性ペースト P を埋め込み、この凹版に対して光透過性を有する中間体 8 を重ね合わせた状態で、凹版の裏側および中間体の裏側の両方から紫外線 UV を照射し、硬化反応を生じさせて導電性ペーストの全周を所定の硬度まで硬化させる。その後、凹版 1 内で硬化した導電性ペーストを中間体 8 に転写した後、中間体 8 上の導電性ペーストを基体 2 0 に再転写する。その後、導電性ペーストを焼成することによって、厚膜配線を基体 2 0 上に形成する。

【選択図】 図 1

特願 2 0 0 2 - 3 5 3 7 7 2

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 6 2 3 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

京都府長岡京市天神二丁目 2 6 番 1 0 号

氏 名

株式会社村田製作所